

Corrugated copper membranes for use in reconfigurable ground plane antenna

Membranes de cuivre ondulées pour usage dans les antennes reconfigurables à plans de mises à la masse

Dwayne D. Chrusch, C. Shafai, L. Shafai, and S. Sharma

Thin-film copper membranes on silicon substrates were constructed using micromachining techniques. Membranes possessed surface corrugations $10\ \mu\text{m}$ deep and ranged in size from $1.04\ \text{mm}$ to $10.0\ \text{mm}$ in diameter. Membranes were released using a combination of both KOH and xenon difluoride (XeF_2) backside etching. Surface corrugations were made using KOH etching on the frontside of the wafer. The membranes were electrostatically actuated using a high-voltage dc supply, and flexibility was studied as a function of diameter. Measured data were compared to simulations of flat and corrugated membranes. Copper membranes were used as a reconfigurable ground plane under a microstrip transmission line. Actuation of the membranes induced phase shift in the transmitted signal. An array of five $4.3\ \text{mm}$ -diameter membranes was tested, as was a single $10.0\ \text{mm}$ membrane, over frequencies ranging from $9.95\ \text{GHz}$ to $35\ \text{GHz}$. A phase shift of 55.63° at $34.42\ \text{GHz}$ was achieved for the array of five $4.3\ \text{mm}$ membranes, and a phase shift of 57.93° at $35.0\ \text{GHz}$ was achieved for the $10.0\ \text{mm}$ membrane.

Des membranes de cuivre en couche mince sur des substrats de silicium ont été construites en utilisant des techniques micromachinage. Les membranes sont caractérisées par des plis de $10\ \mu\text{m}$ de profondeur et de diamètre variant de $1,04\ \text{mm}$ à $10,0\ \text{mm}$. Les membranes sont obtenues par gravure à l'eau-forte en utilisant une combinaison de KOH et de difluorure de xénon (XeF_2) sur la face arrière. Les plis extérieurs sont réalisés par gravure à l'eau-forte de KOH sur la face avant de la gaufrette. Les membranes sont activées électrostatiquement en utilisant une source continue à haute-tension. Leur flexibilité a été étudiée en fonction de leur diamètre. Des données mesurées ont été comparées aux simulations des membranes plates et ondulées. Des membranes de cuivre ont été utilisées comme antennes reconfigurables à plans de mises à la masse sur une ligne de transmission de micro-ruban. L'activation des membranes induit un déphasage dans le signal transmis. Une rangée de cinq membranes de $4,3\ \text{mm}$ en diamètre a été examinée, de même qu'une membrane simple de $10,0\ \text{mm}$, à des fréquences s'étendant de $9,95\ \text{GHz}$ à $35\ \text{GHz}$. Un déphasage de $55,63^\circ$ à $34,42\ \text{GHz}$ a été obtenu pour la rangée des cinq membranes de $4,3\ \text{mm}$, et un déphasage de $57,93^\circ$ à $35,0\ \text{GHz}$ a été obtenu pour la membrane de $10,0\ \text{mm}$.

Keywords: membrane, MEMS, micromachining, microstrip, phase shifter, RF